

Advansic 高性能静電チャック

Electrostatic Chuck

特徴

- ・広温度域に対応出来ます。 (室温～200°C)
- ・吸着・離脱特性に優れています。(2秒以内)
- ・表面状態が優れています。(Ra<0.01μ m)
- ・冷却特性に優れています。(30w/mK)
- ・吸着表面の金属汚染及びパーティクル量が低減できます。
($<10^{10}$ atoms·cm⁻²) (↑0.21μ m<500/8inch-wafer)
- ・フロン系、酸素系プラズマの耐性に優れています。
- ・長寿命



Items		
純度 (除く Al Si)		4N
シリコンウエハへの汚染	atoms/cm ⁻²	< 10 ¹⁰
シリコンウエハ上のパーティクル数	Counts/8inch	<500
吸着力(トット無)	gf/cm ²	>2500
吸脱着時間	sec	<2
バックガスシール性能 (5kPa)	sccm	<0.5
熱伝導度	W/mk	30 22
		at R.T. at 200°C
静電チャックの表面平面度	μ m	2
表面粗さ	μ m	0.01